

パワーデバイス用無電解ニッケル/金、ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス Electroless Ni/Au, Ni/Pd/Au Plating Process for Power Device

トップUBPプロセス TOP UBP PROCESS

- 純アルミニウム、アルミニウム合金スパッタ膜へのめっきプロセス
Plating process for aluminum- and aluminum-alloy sputtering layer

- アルミニウム電極とめっき皮膜間の密着性に優れる
High adhesion performance between aluminum electrodes and plating films

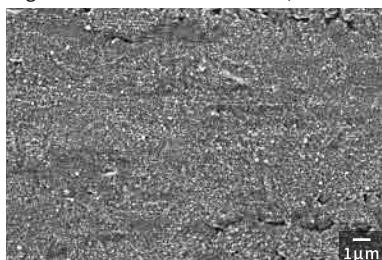
- 熱処理後においても耐クラック性に優れる
high-crack resistance even after heat treatment

処理工程 Process



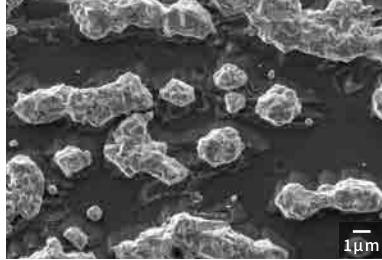
緻密なジンケート析出 Deposit fine zincate films

2nd ジンケート後の表面SEM外観(Al-Si電極上)
SEM image of Al-Si electrode surface (after 2nd zinctate)



観察倍率
Magnification
x5000

トップUBPプロセス TOP UBP PROCESS



一般品 General products

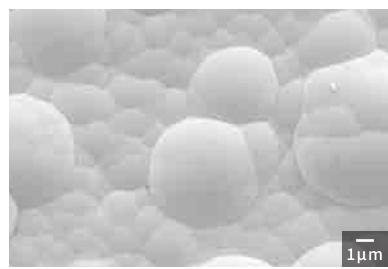
めっき平滑性に優れる前処理 Pre-treatment: can obtain smooth films

無電解ニッケルめっき後の表面SEM外観(Al-Si電極上)
SEM image of Al-Si electrode surface (after electroless nickel plating)



観察倍率
Magnification
x5000

トップUBPプロセス TOP UBP PROCESS



一般品 General products